# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

**GEBIET DES PATENTWESENS** 

# **PCT**

REC'D 3 0 JAN 2006

WIPO PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 241 094 WO	WEITERES VORG	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/	416					
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelo PCT/EP2004/013544 30.11.2004		edatum <i>(TagMonat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Mor 08.12.2003	nat/Jahr)					
Internationale Patentklassifikation (IPK) ode	r nationale Klassifikation u	nd IPK							
C03B19/10, C03C1/02, C03C3/06									
Anmelder		(3.)							
HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO. KG et al.									
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>									
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	mt 4 Blätter einschließ	ich dieses Deckblatts.							
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen								
a. 🗵 (an den Anmelder und das									
zugrunde liegen, und/c	Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).								
Gründen nach Auffass									
l	· · · · ·	-	•						
b. U (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).									
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	1. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:								
□ Feld Nr. I Grundlage des I	Bescheids								
☐ Feld Nr. II Priorität									
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit									
Feld Nr. IV Mangelnde Einh	☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung								
und der gewerb	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung								
	☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen								
	gel der internationalen .	•							
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung								
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts						
30.09.2005		27.01.2006		0 0					
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bediens	teter	aches Patento					
Europäisches Patentamt	0.70		Steeling Wall						
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		Somann, K		spane (A. Spane)					
Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. +49 89 2399-8586		So land online online						

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013544

	Feld Nr. I	Grundlage des Be	richte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			····				_	
1	on gorolonic v	warde, solem unter	diesem Funkt monts	anderes angegebe				
	☐ interi ☐ Verö	<ul> <li>□ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:</li> <li>□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))</li> <li>□ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)</li> <li>□ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)</li> </ul>						
2.	, willionacatific	der <b>Bestandteile</b> * d t auf eine Aufforderu n eingereicht" und si	uku nacii Aliikei 14 f	un vorgelegt wurde	er Bericht auf <i>(Ersatzb</i> n, gelten im Rahmen d	olätter, die dem dieses Berichts al	ls	
	Beschreibung	g, Seiten						
	1-12	0	in der ursprünglich ei	ngereichten Fassung		·		
	Ansprüche, N	lr.						
	1-16		eingereicht mit dem A	Antrag				
	☐ einem Se Sequenzproto	equenzprotokoll und okoll	l/oder etwaigen dazı	ugehörigen Tabeller	n - siehe Zusatzfeld be	etreffend das		
3.	☐ Besch ☐ Anspr ☐ Zeichi ☐ Seque	d der Änderungen si nreibung: Seite rüche: Nr. nungen: Blatt/Abb. enzprotokoll <i>(genau</i> ge zum Sequenzpro	e Angaben):		gaben):	i		
	Auffassung de (Regel 70.2 c)  Besch Anspre Zeichr Seque	er Behörde über der )). nreibung: Seite	n Offenbarungsgeha	us den im Zusatzie. Alt in der ursprünglic	Bericht beigefügten un Id angegebenen Grün ich eingereichten Fassi gaben):			
	* Wenn Pur "ersetzt"	nkt 4 zutrifft, versehen werder	können einige ı.	oder alle die	ser Blätter mit o	der Bemerkung	r	

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013544

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-16

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-16

= macricons rangiton (10)

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-16

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-1 148 035 (HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO. KG) 24. Oktober 2001 (2001-10-24)

D2: WO 01/46079 A (HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO. KG; SHIN-ETSU QUARTZ PRODUCTS CO., LTD) 28. Juni 2001 (2001-06-28)

Weder aus D1 noch D2 geht ein Verfahren hervor, welches zur Herstellung eines Rohlings für ein Bauteil aus laseraktiven Quarzglas dient. Infolgedessen gehen auch keine transparente Rohlinge aus diesen Druckschriften hervor, die durch ein derartiges Verfahren - "Granulat-Pulver-Route" - hergestellt wurden. Dieses aus D1 und D2 bekannte Verfahren zur Herstellung von nicht optischem opaken Glas wurde jetzt zur Herstellung von dotiertem transparenten Laserfähigen Glas erfolgreich eingesetzt, um einen kostengünstigeren Weg bei der Herstellung einzuschlagen, der überdies zuverlässig zu einer homogenen Dotierstoffverteilung und Transparenz führt. Ferner fehlen Hinweise auf Gasdrucksintern aus diesen Druckschriften. Dieser Stand der Technik ist damit kaum geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.

## Neue Patentansprüche 1 bis 16 zu PCT/EP2004/13544

- Verfahren zur Herstellung eines Rohlings für ein Bauteil aus laseraktivem Quarzglas, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
  - a) Bereitstellen einer Dispersion mit einem Feststoffgehalt von mindestens 40 Gew.-%, die in einer Flüssigkeit SiO<sub>2</sub>-Nanopulver sowie Dotierstoffe enthält, welche mindestens ein Kation der Seltenerdmetalle oder der Übergangsmetalle umfassen,
  - b) Granulation durch Bewegen der Dispersion unter Entzug von Feuchtigkeit bis zur Bildung eines dotierten SiO<sub>2</sub>-Granulats aus sphärischen, porösen Granulatkörnern mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 35 Gew.-% und mit einer Dichte von mindestens 0,95 g/cm³,
  - c) Trocknen und Reinigen des SiO<sub>2</sub>-Granulats durch Aufheizen auf eine Temperatur von mindestens 1000 °C unter Bildung einer dotierten, porösen SiO<sub>2</sub>-Körnung mit einem OH-Gehalt von weniger als 10 ppm; und
  - d) Sintern oder Erschmelzen der dotierten SiO<sub>2</sub>-Körnung in einer reduzierend wirkenden Atmosphäre unter Bildung des Rohlings aus transparentem, dotiertem Quarzglas, umfassend ein Gasdrucksintern, welches folgende Verfahrensschritte umfasst:
    - aa)ein Aufheizen der SiO<sub>2</sub>-Körnung auf eine Schmelztemperatur von mindestens 1600 °C unter Anlegen und Aufrechterhalten eines Unterdrucks,
    - bb)ein Halten bei der Schmelztemperatur unter einem Überdruck im Bereich zwischen 5 bar und 15 bar während einer Schmelzdauer von mindestens 30 min unter Bildung des Quarzglas-Rohlings,
    - cc) ein Abkühlen des Quarzglas-Rohlings unter Aufrechterhaltung eines Überdrucks.

- 2 -

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Dispersion ein anfänglicher Feststoffgehalt der von mindestens 50 Gew-% eingestellt wird.
- 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO<sub>2</sub>-Granulat eine BET-Oberfläche im Bereich zwischen 40 m²/g bis 70 m²/g aufweist.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO<sub>2</sub>-Granulat eine BET-Oberfläche von mindestens 50 m<sup>2</sup>/g aufweist.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die sphärischen, porösen Granulatkörner eine Korngröße von weniger als 500 µm aufweisen.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das SiO<sub>2</sub>-Granulat in chlorhaltiger Atmosphäre getrocknet und gereinigt wird.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das SiO<sub>2</sub>-Granulat bei einer Temperatur von mindestens 1050 °C getrocknet und gereinigt wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen und Reinigen des porösen Granulats unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre erfolgt.
- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO<sub>2</sub>-Körnung einen OH-Gehalt von weniger als ein Gew.-ppm aufweist.
- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO₂-Körnung einen eine BET-Oberfläche von weniger als 20 m²/g aufweist.

- 3 -

- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die SiO<sub>2</sub>-Körung vor dem Verfahrensschritt d) thermisch verdichtet wird.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quarzglas-Rohling bei einer Temperatur von mindestens 1120 °C während einer Haltezeit von mindestens 40 h getempert wird.
- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die SiO<sub>2</sub>-Körnung nach Verfahrensschritt d) in einer Form erschmolzen wird.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der SiO<sub>2</sub>-Rohling nach Verfahrensschritt d) dreidimensional homogenisiert wird.
- 15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass SiO<sub>2</sub>-Körnung unterschiedlicher Brechzahl ein Schüttkörper mit einer radial inhomogenen Brechzahlverteilung gebildet wird, und dass der Schüttkörper zu dem SiO<sub>2</sub>-Rohling gesintert oder erschmolzen wird.
- 16. Verwendung eines nach einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 15 erhalten SiO<sub>2</sub>-Rohlings als Kernmaterial für einen Faserlaser, als optischer Filter oder als Umhüllungsrohr für Laser.